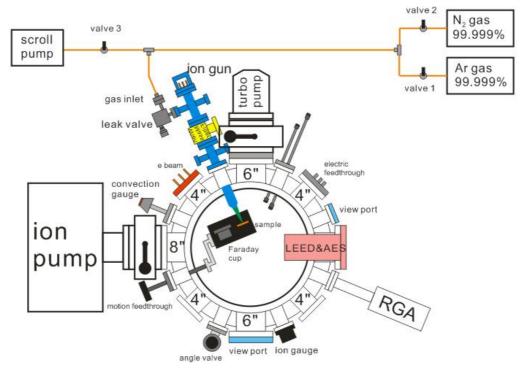
## 離子槍操作步驟

## 架設圖



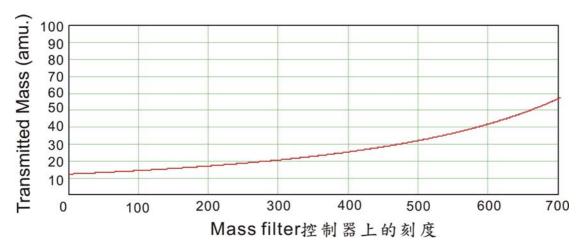
- 1. 参照"超高真空系統操作標準作業程序"中的 scroll pump 及 turbo pump 的使用程序,將腔體內壓力抽至約  $5x10^{-9}$  torr。
- 2. 暫時關閉接在 turbo pump 上的 angle valve, 然後打開 valve 3, 讓 scroll pump 將氣體管線內的殘餘氣體抽盡,約一分鐘後再將 angle valve 打開。



離子槍(下)與 Mass filter(上)的控制器



- 3. 開啟離子槍控制器(PU-IQE 12/38)的開關,開始設定參數。先按"Modify",再選擇參數按鍵,此時在 parameter value 下方會有倒三角符號一直閃爍,如上圖。改變 parameter value 時可用轉盤控制數值,也可在面板上按住"Num",然後在數字鍵直接輸入所需的數值。以 find beam mode (minimum beam size) 爲例,Energy = 5000 V,Extractor = 92%(相對於 Energy 的電壓值),Focus1 = 77%,Focus2 = 73%,Emission = 10 mA。注意:Extractor 不可低於 60%
- 4. 重覆按 "**Setup**" 直到 parameter name 跳至 "**L**" ,將 L 的數值設定為 87 mm (L 定義為 sample 至離子槍內 x 軸方向偏折板中心的距離)。**注意:此參數** 只能在 off mode 條件下設定。
- 5. 按離子槍控制器上的"**DEGAS**",此動作是對離子槍內的燈絲做 degas,此時壓力會快速上升,當壓力值達  $10^5$  torr 時,立即再按一次"**DEGAS**"(結束 degas 動作),這是要避免離子槍內壓力過高導致燈絲壽命減少甚至燒斷,讓腔體內的壓力再抽至  $10^7$  torr 以下時,再執行 degas 動作如此反覆幾次,直到 degas 時壓力值無高於  $10^7$  torr,此時無須自行結束 degas,等待數分鐘後控制器面板會顯示"**STANDBY**",代表 degas 已結束。(按照"超高真空系統操作標準作業程序",**Degas** 的動做應於腔體加熱過程中執行)
- 6. 關閉 valve 3,打開氣體鋼瓶的閥門,調整 regulator 使輸出壓力約為 50 psi, 然後打開 regulator 的閥門及 valve 2。
- 7. 開啟 Mass filter 控制器的開關,並按下按鈕使 "On"的燈亮起
- 8. 依照下圖中的曲線圖,調整 Mass filter 控制器上 "Mass"的旋鈕,使其刻度 是對應到所需的離子源。



- 9. 微調 leak valve 的閥門將氣體放入離子槍中,並使腔體壓力維持在  $3x10^{-7}$  torr 10. 按控制器上的 "**OPERATE**" 開始放出離子源。
- 11. 用磷光板觀察 ion beam profile, 改變 FOCUS 1 及 FOCUS2 來改變 beam size。
- 12. 將離子東打在 Faraday cup 上,並從 source meter 觀察電流値,假如電流値與預設値有誤差的話,則改變**腔體內氣體壓力、EMISSON、EXTRACTOR、FOCUS 1** 及 **FOCUS 2** 的值使得量測的電流値如同預設値。
- 13. 將靶材正對離子槍,開始進行離子轟擊。

註:假如離子槍運作的中途,若要暫時停止離子源射出,可按"HV",此時"HV"上的紅燈會熄滅,代表控制器無輸出任何高壓,但離子槍內還是有持續供應電流給燈絲。若要恢復運作,則再按一次"HV"即可。